

11	半導體廠瓶頸機台之作業時間量測	
指導教授	陳光辰	博士
參與學生	u920847 周世寶	
摘 要		
半導體業的製造系統是現今產業中耗費成本最大，製程步驟數最多與機器設備最複雜的高科技產業之一。而在半導體業前端的晶圓生產當中，瓶頸機台(Key Machine)的產能是影響晶圓產出(Wafer Out)的重要關鍵。若能縮短瓶頸機台的作業時間，使其單位時間產量增加，則可使產業的獲利大為提高。 本專題乃利用暑假的時間，到新竹科學園區某半導體公司晶圓製造處的生產規劃部實習。在主管的要求下，實際進入工廠(Fab)，針對瓶頸機台的各項作業流程，利用碼表測時法，進行作業時間的測量。並將測量的結果與期間所發現的問題回報給主管，然後再與相關的製程或設備單位的工程師討論，設法尋求機台作業改善的空間。		